

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成28年1月28日(2016.1.28)

【公表番号】特表2015-505291(P2015-505291A)

【公表日】平成27年2月19日(2015.2.19)

【年通号数】公開・登録公報2015-011

【出願番号】特願2014-546502(P2014-546502)

【国際特許分類】

C 03 B 8/04 (2006.01)

C 03 B 37/018 (2006.01)

G 02 B 1/02 (2006.01)

【F I】

C 03 B 8/04 C

C 03 B 8/04 D

C 03 B 37/018 C

G 02 B 1/02

【手続補正書】

【提出日】平成27年12月4日(2015.12.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

合成石英ガラスの製造方法であって、以下の方法工程：

(A) オクタメチルシクロテトラシロキサンを70質量%超有する、液体のSiO<sub>2</sub>出発材料(105)を準備する工程、

(B) 液体のSiO<sub>2</sub>出発材料(105)を蒸発させて、気体のSiO<sub>2</sub>出発蒸気(107)にする工程であって、膨張チャンバー(125)中でSiO<sub>2</sub>出発材料(105)を微細な液滴に噴霧化する噴射段階を含み、ここで、前記液滴の噴霧化をキャリアガス流中で行う前記工程、

(C) SiO<sub>2</sub>出発蒸気(107)をSiO<sub>2</sub>粒子に変換する工程、

(D) 前記SiO<sub>2</sub>粒子を、SiO<sub>2</sub>スート体(200)の形成下に堆積面(160)に堆積させる工程、

(E) 前記SiO<sub>2</sub>スート体を、合成石英ガラスの形成下にガラス化する工程、  
を含んでいる前記方法において、

前記液滴が、5μm未満の平均直径を有しており、かつ噴霧化の間に、キャリアガス/SiO<sub>2</sub>出発材料のモル比1.5以上で該液滴を前記キャリアガス流と混合し、ここで、前記キャリアガス流が、あらかじめ180超の温度に加熱されていることを特徴とする前記方法。

【請求項2】

SiO<sub>2</sub>出発材料(105)が、微細な液滴に噴霧化され、ここで、該液滴が、2μm未満の平均直径を有していることを特徴とする、請求項1に記載の方法。